



# ガラス、セラミックスの硬度測定

従来は困難であったガラス・セラミックスの硬度測定技術を確立しました。  
お客様の問題解決・開発を支援します。

## 研磨技術と硬さ測定装置仕様

- 研磨技術 : 機械研磨と断面イオンミリングの併用

### 断面イオンミリングの特徴

- ◆ 鏡面研磨の試料表面の研磨疵やダレを除去できる。

- 対象試料 : ガラス、セラミックス等

### <硬さ試験機>

- 測定用圧子 : ダイヤモンド
- 試験荷重 : 10、20、30、50、100、200、300、500、1000 (g)
- 試験片寸法 : 最大φ50mm×高さ25mm、  
(測定面は最大5mmφの鏡面)

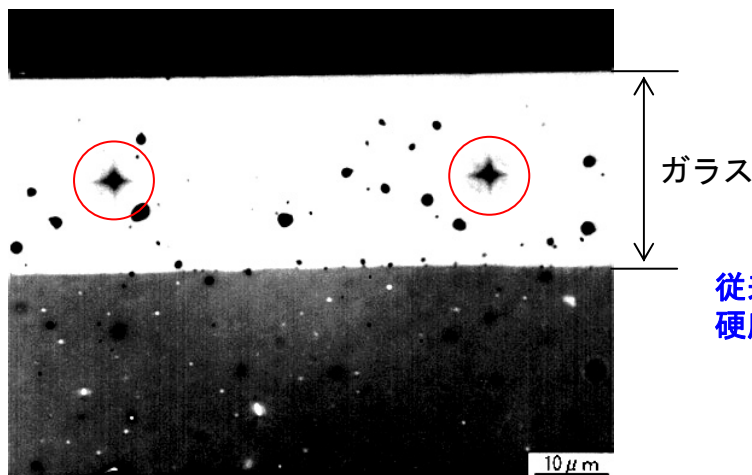


断面イオンミリング加工装置: 日立ハイテック社製 IM4000



硬さ測定装置: ミットヨ社製 HM-221

## 圧痕観察例 (素材はガラス)



機械研磨+断面イオンミリング後の圧痕の状態  
(○で囲んだものが圧痕)

従来できなかったガラス・セラミックスの  
硬度測定が可能になりました。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<http://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2011 - 2012 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.  
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。